

## 走査電子顕微鏡・JSM6390LV

製造元	日本電子株式会社
仕様	走査電子顕微鏡 JSM-6390LV, 分解能 : 3.0nm(30kV), 8nm(1kV),15nm(1kV), 加速電圧 : 0.5kV ~ 30kV, 低真空圧力 1 = 270Pa
保有部署	社会基盤工学専攻, 地盤力学研究室
設置場所	桂・C1棟・B1階045号室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 <a href="https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/hxrvi1">https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/hxrvi1</a>
注意事項等	<ul style="list-style-type: none"><li>・工学系材料の観察に限ります。その他の材料を希望する場合は、事前に相談し承諾を得てください。</li><li>・湿潤状態の材料は観察困難です。</li></ul>
連絡先	社会基盤工学専攻 地盤力学研究室 教授 肥後陽介 075-383-3260 <a href="mailto:higo.yohsuke.5z@kyoto-u.ac.jp">higo.yohsuke.5z@kyoto-u.ac.jp</a>
キーワード	表面形状観察, 微細構造, 低真空
機器コード	0000113001
自由記入欄	本装置は、30kVで3nmを保証する高性能スーパーコンカル対物レンズを搭載し、シャープな画像が高いコントラストで得られる走査電子顕微鏡です。新走査システムは8倍以下の極低倍率観察を実現し、視野探し・視野移動を効率的に行うことができます。電子銃は完全自動化されており、ズームコンデンサレンズにより加速電圧や試料電流を変えても画像が逃げず試料電流の設定が直観的に行えます。

令和6年3月1日現在

